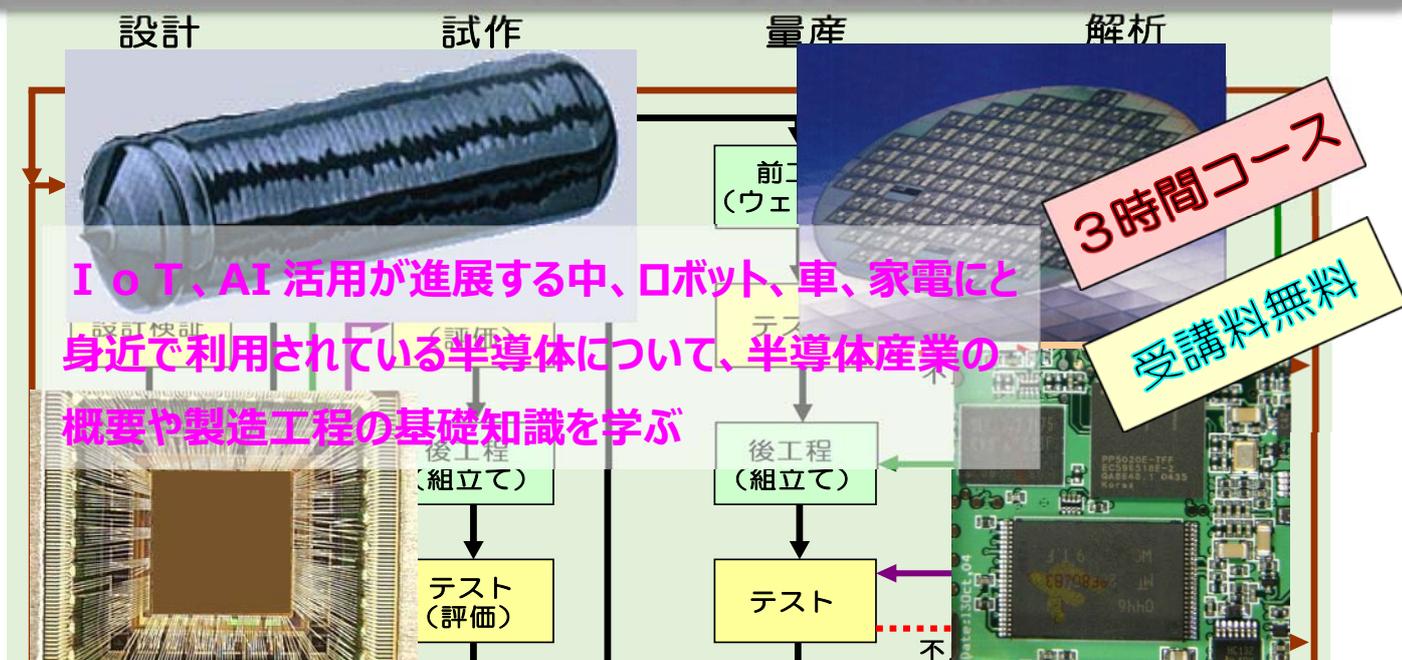


# 令和2年度 半導体基礎講座



**内容** 半導体産業の概要、および半導体製品の開発から製造、テストにいたるまでの工程概要と要素技術

**期間** ① 2020年9月16日(水) 時間 13:30 ~ 16:30  
② 2020年9月23日(水) 時間 13:30 ~ 16:30  
③ 2020年9月30日(水) 時間 13:30 ~ 16:30  
※1回のみでの参加も可能です。

**会場** 大分県産業科学技術センター 多目的ホール(1F) ※変更の可能性あり  
※会場で聴講できない方のために「ZOOM」配信を致します。

**講師** 大野 武雄氏 (大分大学 理工学部 准教授)  
筒井 信明氏 (半導体人材育成教育コンサルタント)

**受講対象者** LSI クラスタ会員企業の方(技術・事務を問いません)、  
または会員企業に就職予定の方

**定員** 各講座 40名

## 講座のねらい・特徴

半導体産業・動向から半導体製造工程やテストについての基礎知識・要素プロセス技術を短期間に学べる。

半導体産業・製造の基礎知識を学ぶことにより、今後従事する、または従事している職務のレベルアップや改善が図れる。

当講座は「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)」を利用している、もしくは利用予定の事業所が外部委託訓練として利用できる講座です。  
(制度の詳細は、最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい)

**主催:**  大分県 LSI クラスタ形成推進会

<http://www.oita-lsi.jp/>

# 令和2年度 半導体基礎講座（3時間コース）

半導体基礎講座① 9月16日（水） 講師：大野 武雄氏		
半導体分野の基礎知識 （半導体について）	半導体とは	半導体材料について 半導体チップの中身 LSIについて 各種トランジスタ 半導体とノーベル賞
	半導体産業の状況	半導体市場について 半導体と他の分野との関わり

半導体基礎講座② 9月23日（水） 講師：筒井 信明氏		
半導体開発・製造工程概論 （ウェーハ製造）	LSI 開発・製造の流れ	LSI 開発・製造の全体フロー
	LSI の開発・設計	LSI 開発の流れ 設計 フォトマスク
	シリコンウェーハ	シリコンウェーハの製造 シリコンウェーハ口径と平坦性の推移
	ウェーハ処理工程	ウェーハプロセス リソグラフィ工程 エッチング工程 洗浄工程 イオン注入工程 熱処理・成膜工程 配線および電極形成工程

半導体基礎講座③ 9月30日（水） 講師：筒井 信明氏		
半導体製造工程概論 （組み立て、テスト）	LSI 開発・製造の流れ	LSI 開発・製造の全体フロー
	組み立て工程	実装技術 パッケージタイプの変遷 パッケージング
	半導体評価・テスト・解析	評価・テスト・解析の役割
		評価 テスト 解析

## 参加申込規定

- 申込書に必要事項をご記入のうえ、E-mailまたはFAXでお送りください。
- 申込人数が定員に達し次第、締め切らせていただきます。
- 申込人数が少ない場合、講座を延期もしくは中止することがあります。

## ご注意

- 駐車場：別紙(1)を参照ください。
- 研修室内での飲み物は可能ですが、食事はご遠慮ください。
- 録音機、カメラの持ち込み、撮影はご遠慮ください。
- テキストは会場での受講者のみにお渡し致します。  
※詳しくは事務局へ問い合わせ願います
- 受講証明書は発行致しませんので、必要な方はお申し出ください。  
後日、電子ファイルにて送付致します。

## 会場



コース名	回数	開催日
半導体基礎講座①（半導体分野の基礎知識：半導体について）	1	9月16日（水）
半導体基礎講座②（半導体製造工程概論：ウェーハ製造）	1	9月23日（水）
半導体基礎講座③（半導体製造工程概論：組立て、テスト）	1	9月30日（水）

※ 1回のみの参加も複数回の参加も可能です。

## お問い合わせ＆お申込先

FAX (0977)72-9968 / E-mail et-course@elia-jp.com

〒879-1507 大分県速見郡日出町大字豊岡字岩垣 799 番地 1 (株)エリア 日力/小石 ☎0977-73-2485

駐車場は(2)の駐車場をご利用願います。

